

CONTENTS

Verner V. D., Ivanov A. A., Kolomenskaya N. G., Luchinin V. V., Maljtcev P. P., Popova I. V., Saurov A. N., Teletc V. A. <i>The Produces of Microsystems Techniques — Terms and Definitions, Classification and Indication of Types</i>	2
Luchinin V. V. <i>Nanoindustry and "Human Capital"</i>	6
Ageev O. A., Konoplev B. G., Polyakov V. V., Svetlichniy A. M., Smirnov V. A. <i>Investigation of Photon Stimulated Probe Nanolithography Regimes by Local Anodic Oxidation of Titanium Film</i>	14
Kozlov A. G. <i>Thermal Microsensors: Design Features</i>	16
Yashin K. D., Osipovich V. S., Bozhko T. G. <i>Developing of Mems</i>	28
Galoushkov A. I., Saurov A. N., Pogalov A. I. <i>Modelling, Dynamic and Strength the Analysis of Inertial Sensor Nanoelements</i>	34
Gridnev S. A., Gorshkov A. G., Sitnikov A. V., Samalyuk N. V. <i>Effect of Electric Field on the Crystallization Process of Thin Film Amorphous Metal-Ferroelectric Nanocomposites</i>	38
Marakhtanov M. K., Dukhopelnikov D. V., Mei Xian Xiu. <i>The Dispersing Characteristics of the Nanosize Metal Films in a Visible Radiation</i>	42
Bryukhova Yu. V., Zaitsev N. A. <i>The Analysis of Mismatch of Physicotechnical Parameters of Semiconductor Devices</i>	48
Ahmetov D. G., Kostsov E. G., Sokolov A. A. <i>Microelectromechanical Electrostatic Highpower Injectors of Liquid Microjets</i>	53
Mokrov E. A., Belozubov E. M., Belozubova N. E. <i>On Termal Electromotive Force Compensation in Thin-Film MEMS for Strain Sensors at Unstable Temperature Conditions</i>	61
Vekshin M. M., Yacovenko N. A. <i>Characteristics of Plasmon-Resonance Biosensors on Submicron Diffraction Gratings</i>	65
Khorunzhii I. A., Domanevsky D. S., Bobuchenko D. S. <i>Computer Optimization of Heat Sink Parameters for Cooling of Powerful Semiconductor Device</i>	70

For foreign subscribers:

Journal of "NANO and MICROSYSTEM TECHNIQUE" (Nano- i mikrosistemnaya tekhnika, ISSN 1813-8586)

The journal bought since november 1999.

Editor-in-Chief Ph. D. Petr P. Maltsev

ISSN 1813-8586.

Address is: 4, Stromynsky Lane, Moscow, 107076, Russia. Tel./Fax: +7(495) 269-5510.

E-mail: nmst@zknet.ru; http://www.microsystems.ru

Адрес редакции журнала: 107076, Москва, Стромьинский пер., 4/1. Телефон редакции журнала (495) 269-5510. E-mail: nmst@zknet.ru

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № 77-18289 от 06.09.04.

Дизайнер Т. Н. Погорелова. Технический редактор Е. М. Патрушева. Корректор Волкова Е. Г.

Сдано в набор 20.11.2007. Подписано в печать 00.12.2007. Формат 60×88 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 9,8. Уч.-изд. л. 12,17. Заказ 24. Цена договорная

Отпечатано в ООО "Подольская Периодика", 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, 15